

機器利用技術講習会のご案内

【高精度フォトリソグラフ】

地方独立法人大阪府立産業技術総合研究所では、所有している試験研究機器等を用いて、中小企業の皆様の新技术・新製品の開発や生産管理・品質管理をお手伝いさせて頂いております。これら試験研究機器の利用範囲や仕様・性能などの特徴を、より具体的にご理解いただき、皆様方に一層ご利用頂くため、下記の要領で講習会を開催しますのでご案内申し上げます。

◆日 時：平成26年10月1日(水) 13:15~15:30

*当日、「フォトマスク作製装置【レーザー描画装置】(9:30~12:15)」の機器利用技術講習会も行っております。この機器利用技術講習会では、フォトマスク設計のコツ、フォトマスク作製装置の簡単な解説を聴講していただいた後、実際にフォトマスクを作製していただきます。装置の理解をより深めるためにも「フォトマスク作製装置【レーザー描画装置】」の機器利用技術講習会を当講習会とあわせて受講されることを強く推奨いたします。講習会の後、ご希望される方には関連装置をご見学いただけます。

◆場 所：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所(和泉市あゆみ野2-7-1)

当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。

◆定 員：5名(1社1名まで)

※ 受講票は発行いたしません。

※ 受講には TRI カードが必要です。まだお持ちでない方は当日お申し込みいただけます(無料)。

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所 顧客サービス室 顧客サービス課

※ お申し込みはメール (fukyu@tri-osaka.jp) またはFAX (0725-51-2509) までお願いします。

メールでお申し込みを頂いた方のみ、返信にて受付をお知らせします。

なお、メールでお申し込みを頂いた方には、当研究所の関連情報をご案内する「産技研ダイレクトメールニュース」を配信させていただきますので、ご了承下さい。

◆対象機器：高精度フォトリソグラフ装置

高精度フォトリソグラフ装置(マスクアライナー)は、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)加工や半導体微細加工において基盤となるフォトリソグラフィに用いる装置です。本講習では、マスクアライナーを用いたフォトリソグラフィを体験したい方を対象に、機器の概要説明を行った後、装置の操作方法を説明し、フォトリソグラフィの実習をします。当日午前実施される機器利用技術講習会で作製したフォトマスクを使って、Si基板上に塗布したフォトレジストをマスクアライナー(露光機)により、露光・現像してパターンニングします。



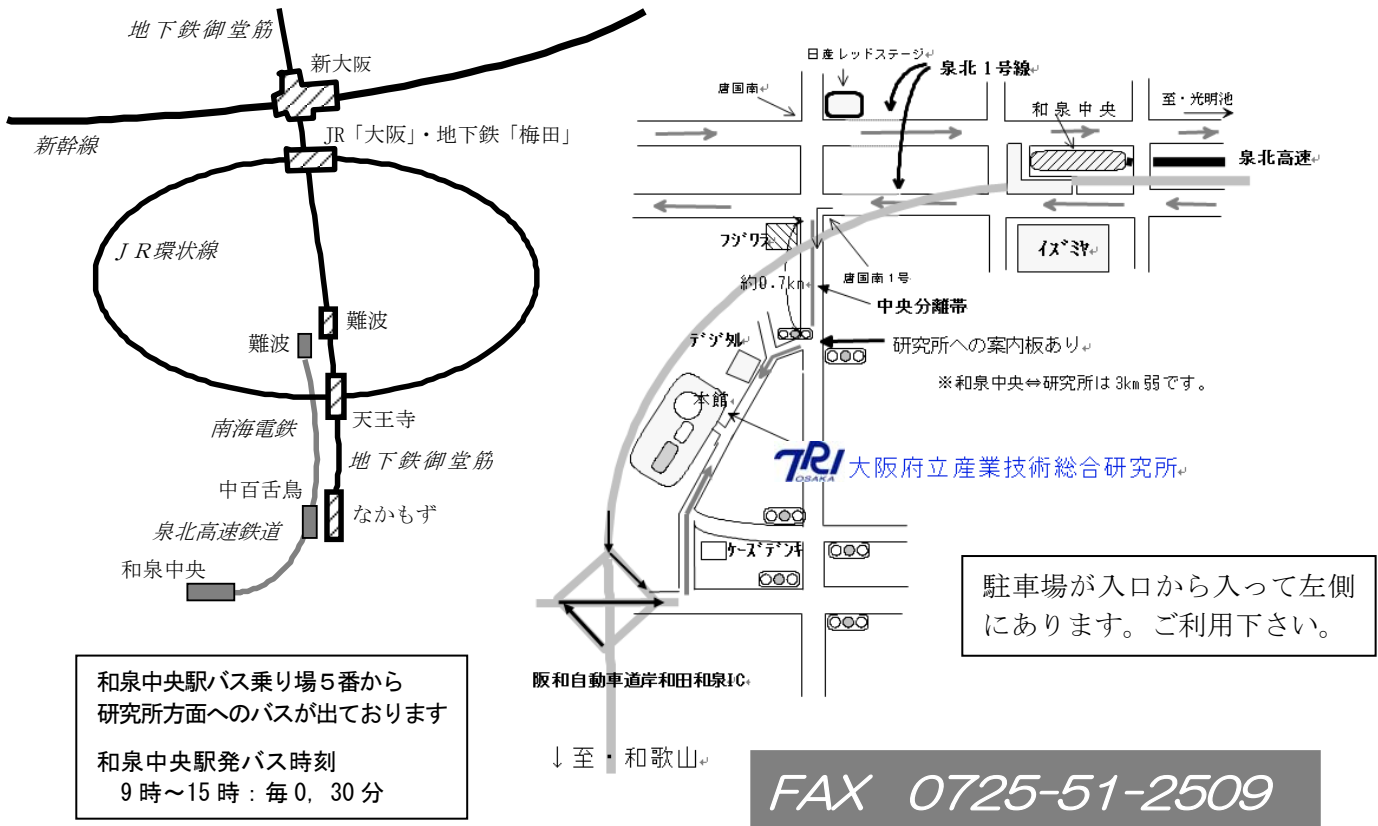
機器型番：SUSS MA-4

◆講習担当：(地独)大阪府立産業技術総合研究所

制御・電子材料科 田中恒久、宇野真由美、村上修一、金岡祐介、中山健吾

・お問い合わせ先：顧客サービス課 (TEL：0725-51-2518)

大阪府立産業技術総合研究所交通案内図(略図)



和泉中央駅バス乗り場5番から
研究所方面へのバスが出ております
和泉中央駅発バス時刻
9時～15時：毎0、30分

駐車場が入口から入って左側
にあります。ご利用下さい。

FAX 0725-51-2509

機器利用技術講習会申込書 テーマ「高精度フォトリソグラフ」

開催日：平成26年10月1日(水)

会社名	
所在地	(〒)
参加者	所属： 役職： 氏名： TRIカードをお持ちの方は、「K番号」のご記入もお願いします。(K)
連絡先	TEL： FAX：
講習会の情報源	①産技HP ②産技メール配信 ③講習会チラシ ④他機関の情報 ⑤その他()

講習会の案内など、当研究所の関連情報をお知らせする「産技研ダイレクトメールニュース」の配信
をご希望の方は、下記にメールアドレスをご記入下さい。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ※上記参加申込書に記載された内容につきましては、本講習会の参加者の集計及び下記の目的に使用させていただきます。
- ①お客様からの問い合わせへの対応、当研究所利用に関する手続きの案内など、お客様サポート。
 - ②当研究所および関連団体の催事情報提供などの案内